

等离子蚀刻机 PI01

适用于太阳能电池制程，对矽晶片之边缘做蚀刻

特点

- 专利设计之特殊等离子电极
- 高密度等离子源
- 处理速度快、产能高、可靠度高
- 可选择的操作参数多
- 设备稳定度高，容易维护
- 全自动且容易操作
- 可依客户需求作更改

应用产业

- 太阳能电池
- 太阳能矽晶片边缘做蚀刻



Specifications

Footprint	1270(W)×1110(D)×2216(H)mm
Chamber Size	500(W)×500(D)×500(H)mm
Weight	880kg
Facilities	3Ø220V×60Hz×4w, 30A Compressed air : about 6 kg/cm ² Reaction gas : about 2 kg/cm ²
System Control Software	PLC touch panel or PC based system controller
Gas Flow System	2 mass flow controllers
Vacuum Pump	Dry pump
Reactants	O ₂ , CF ₄
Telescopic stage	Easy loading accessory
Cell clamp	Cell stack holder with stacking accessory

